

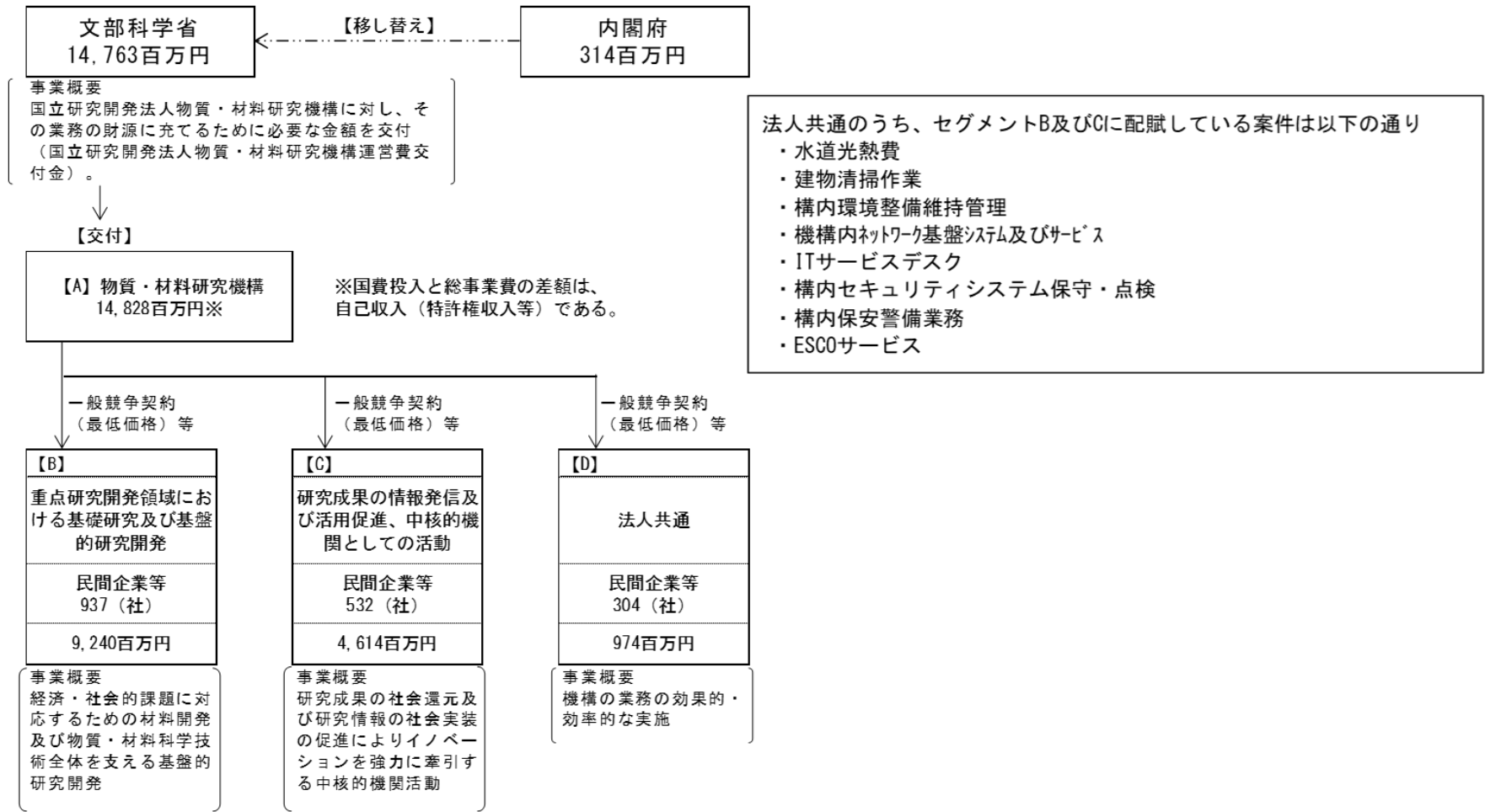
	令和5年度行政事業レビューシート					(文部科学省)		
事業名	国立研究開発法人物質・材料研究機構運営費交付金に必要な経費			担当部局庁	研究振興局		作成責任者	
事業開始年度	平成13年度	事業終了 (予定)年度	終了予定なし	担当課室	参事官(ナノテクノロジー・物質・材料担当)	参事官(ナノテクノロジー・物質・材料担当) 宅間 裕子		
会計区分	一般会計							
根拠法令 (具体的な 条項も記載)	国立研究開発法人物質・材料研究機構法第15条			関係する 計画、通知等	第5期科学技術基本計画(平成28年1月閣議決定) 第6期科学技術・イノベーション基本計画(令和3年3月閣議決定)			
政策	9 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題への対応			主要経費	科学技術振興費			
施策	9-1 未来社会を見据えた先端基盤技術の強化							
政策体系・評価書URL	https://www.mext.go.jp/content/20221012-mxt_kanseisk01-000024706-07.pdf							
事業の目的 (5行程度以内)	社会のあらゆる分野を支える基盤となる物質・材料科学技術に関して、基礎研究及び基盤的研究開発等の業務を総合的に行い物質・材料科学技術の水準の向上を図るとともに、物質・材料科学を牽引する国の中核的機関として、社会的ニーズに応える幅広い分野の革新を先導することを目的とする。							
現状・課題 (5行程度以内)	蓄電池・半導体・量子・バイオ等の産業・研究開発の基盤であるマテリアル分野は近年新興国の強烈な追い上げを受け、世界トップレベルの成果やイノベーションの創出が我が国において急務となっている。このことからNIMSは、我が国におけるマテリアル分野の科学技術を牽引する機関として優秀な研究者及び技術者が集まる魅力的な研究環境を整備し、基礎研究及び基盤的研究開発を強力に推進する必要がある。							
事業概要 (5行程度以内)	国立研究開発法人物質・材料研究機構は、社会のあらゆる分野を支える基盤となる物質・材料科学技術を牽引する国の中核的機関として以下の業務を実施する。 ・物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 ・前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 ・機構の施設及び設備を科学技術に関する研究開発を行う者の共用に供すること。 ・物質・材料科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。 ・科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成三十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。 ・前各号の業務に附帯する業務を行うこと。							
事業概要URL	https://www.nims.go.jp/							
実施方法	交付							
補助率等	-							
予算額・ 執行額 (単位:百万円) (インプット)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度要求	
	予算の 状況	当初予算(A)	13,787	14,239	14,417	14,419	17,051	
		補正予算(B)	-	-	31	235		
		令和5年度第1次補正予算				235		
						-		
						-		
						-		
						-		
		前年度から繰越し(C)	-	-	-	-	-	
		翌年度へ繰越し(D)	-	-	-	-		
		予備費等(E)	343	114	314	-		
	計(F) =(A)+(B)+(C)+(D)+(E)	14,130	14,353	14,762	14,654	17,051		
	執行額(G)		14,131	14,353	14,763			
	執行率(%) =(G)/(F)		100%	100%	100%			
	当初予算+補正予算に対する執行額の割合(%) =(G)/[(A)+(B)]		102%	101%	102%			
令和5・6年度 予算内訳 (単位:百万円)	歳出予算項・目		令和5年度当初予算	令和6年度要求	主な増減理由(・要望額・予備費)			
	(項)		国立研究開発法人物質・材料研究機構運営費		重要政策推進枠 3,944百万円			
		(目)	国立研究開発法人物質・材料研究機構運営費交付金	14,419				17,051
			その他					
	計(A)		14,419	17,051				

活動内容① (アクティビティ)		物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行う。									
↓											
活動目標及び活動実績 ① (アウトプット)		活動目標	活動指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	5年度 活動見込	6年度 活動見込	
		研究成果等の創出	査読付き発表論文数 * 平成28年度からの毎年平均値	活動実績	件	1,319	1,362	1,377	-	-	
				当初見込み	件	1,100	1,100	1,100	1,200	-	
↓	成果目標①-1の 設定理由 (アウトプットからのつながり)	アウトプット「研究成果等の創出」の活動指標「査読付き発表論文数」が増加することによる研究成果の創出が、短期アウトカム「イノベーション創出に資する優れた知的財産の創出」の定量的な成果指標「外国特許出願数」の増加に向けた相乗効果につながる。なお、実用化された製品についてはグローバル市場における販売が想定されるため、外国特許の出願を重視し、特許性や市場性等を考慮しつつ、費用対効果の観点から厳選して出願・権利化を行う。									
成果目標及び成果実績 ①-1 (短期アウトカム)		成果目標	定量的な成果指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	目標年度 5 年度		
		イノベーションの創出に資する優れた知的財産の創出	外国特許出願数	成果実績	件	126	138	145	-		
				目標値	件	100	100	100	100		
				達成度	%	126	138	145	-		
成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名(出典)/定性的なアウトカムに関する成果実績		NIMS調べ									
↓	成果目標①-2の 設定理由 (短期アウトカムからのつながり)	外国特許出願数ののち特許が認められることで、グローバル市場での優位性を得ることできる。国内外での企業が当該研究成果を用いた実用化を行うためには、実施許諾契約を行う必要が生じる。特許出願から民間企業へのライセンスに至るまでには候補先となる企業とのマッチングに長期間を要するケースが多いため、長期アウトカムとして設定している。									
成果目標及び成果実績 ①-3 (長期アウトカム)		成果目標	定量的な成果指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	目標最終年度 11 年度		
		研究成果の実用化のための民間企業へのライセンス	実施許諾契約件数(新規・継続を合わせた総数)	成果実績	件	142	147	146			
				目標値	件	90	90	90	120		
				達成度	%	157.8	163.3	162.2			
成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名(出典)/定性的なアウトカムに関する成果実績		NIMS調べ									
アウトカム設定についての説明		アクティビティ①について定性的なアウトカムを設定している理由									
		-									
		アクティビティ①についてアウトカムが複数設定できない理由									
		-									

活動内容② (アクティビティ)		(国研)物質・材料研究機構の研究成果の普及を図るための取組を進め、マテリアル分野の研究開発の重要性や魅力及び研究成果等に対する理解増進に取り組む。								
↓										
活動目標及び活動実績 ② (アウトプット)		活動目標	活動指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	5年度 活動見込	6年度 活動見込
		研究成果等の情報発信	広報誌「Web版NIMS NOW」発行回数	活動実績	回	12	12	12	－	－
				当初見込み	回	－	－	－	－	－
↓	成果目標②-1の 設定理由 (アウトプット からのつながり)	アウトプット「研究成果等の情報発信」の活動指標広報誌「Web版NIMS NOW発行回数」の達成により、短期アウトカム「研究成果等の情報発信の影響力拡大」の定量的な成果指標「広報誌「Web版NIMS NOWアクセス回数」」を獲得し、研究成果等に対する理解増進につながる。								
成果目標及び成果実績 ②-1 (短期アウトカム)		成果目標	定量的な成果指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	目標年度 5 年度	
		研究成果等の情報発信の影響力拡大	広報誌「Web版NIMS NOW」アクセス回数	成果実績	回	294,149	239,890	34,377	－	
				目標値	回	－	－	－	－	
				達成度	%	－	－	－	－	
成果実績及び目標値の 根拠として用いた 統計・データ名(出典) /定性的なアウトカムに 関する成果実績		NIMS調べ ※令和3年度成果実績値については、機構全体の基幹ネットワークシステム刷新により継続的な集計が不可となったため 4 月～12月分の実績値である。 ※令和4年度の成果実績値は、基幹ネットワークシステム刷新に伴い令和4年4月より開始した新しい集計方法による数値である。								
↓	成果目標②-2の 設定理由 (短期アウトカム からのつながり)	我が国唯一の物質・材料研究分野における基礎研究及び基盤的研究開発の中核的機関であり、国立研究開発法人物質・材料研究機構法に基づき、物質・材料科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ることを業務としている。その際広報誌「Web版NIMS NOW」は、国内の民間企業・大学・研究機関などを対象に、注目の研究成果や外部機関との連携等について情報発信しており、物質・材料研究を支える研究者の養成及び資質の向上に資するものである。この成果として当該分野の中核的機関として若手研究者を受け入れるまでには、長期間を要するケースが多いため、長期アウトカムを設定している。								
成果目標及び成果実績 ②-3 (長期アウトカム)		成果目標	定量的な成果指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	目標最終年度 11 年度	
		物質・材料研究を支える研究者の養成 及び資質の向上	若手研究者の受け入れ人数	成果実績	人	477	498	615	－	
				目標値	人	350	350	350	－	
				達成度	%	136.3	142.3	175.7	－	
成果実績及び目標値の 根拠として用いた 統計・データ名(出典) /定性的なアウトカムに 関する成果実績		NIMS調べ								
アウトカム設定について の説明		アクティビティ②について定性的なアウトカムを設定している理由								
		－								
		アクティビティ②についてアウトカムが複数設定できない理由								
		－								

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)
(単位：百万円)

※令和4年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
なお、金額は単位未満四捨五入して記載していることから、合計が一致しない場合がある。



費目・使途
(「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載)

A.			B.		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
運営費交付金	物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発等の業務	14,828	光熱水料	干現地区で使用する電気(重点研究開発領域に置ける基礎研究及び基盤的研究開発)	591
計		14,828	計		591
C.			D.		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
光熱水料	干現地区で使用する電気(研究成果の情報発信及び活用促進、中核的期間としての活動)	184	リース	機構内ネットワーク基盤システム	801
計		184	計		801

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙2】に記載

チェック

支出先上位10者リスト

A.

	支 出 先	法 人 番 号	業 務 概 要	支 出 額 (百万円)	契約方式等	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は競争性のない随意契約となった理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	国立研究開発法人物質・材料研究機構	2050005005211	物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発等の業務	14,828	運営費交付金交付	-	-	-

B

	支 出 先	法 人 番 号	業 務 概 要	支 出 額 (百万円)	契約方式等	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は競争性のない随意契約となった理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	東京電力エナジーパートナー株式会社	8010001166930	千現地区で使用する電気(重点研究開発領域に置ける基礎研究及び基盤的研究開発)	591	一般競争契約(最低価格)	1	-	-
2	東京電力エナジーパートナー株式会社	8010001166930	並木地区で使用する電気(重点研究開発領域に置ける基礎研究及び基盤的研究開発)	508	一般競争契約(最低価格)	1	-	-
3	東京電力エナジーパートナー株式会社	8010001166930	桜地区で使用する電気(重点研究開発領域に置ける基礎研究及び基盤的研究開発)	79	一般競争契約(最低価格)	2	-	-
4	東京電力エナジーパートナー株式会社	8010001166930	並木地区で使用するガス(重点研究開発領域に置ける基礎研究及び基盤的研究開発)	65	一般競争契約(最低価格)	1	-	-
5	三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社	6010701009572	機構内ネットワーク基盤システム及びサービス(重点研究開発領域に置ける基礎研究及び基盤的研究開発)	181	一般競争契約(最低価格)	2	-	-
6	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	MI解析用GPUサーバ	1	随意契約(少額)	-	-	-
7	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	3Dステレオカメラ	1	随意契約(少額)	-	-	-
8	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	深層学習向け高性能ワークステーション	0.9	随意契約(少額)	-	-	-
9	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	デスクトップパソコン	1	随意契約(少額)	-	-	-
10	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	PCクラスタノードサーバの増設用メモリ(13枚)	1	随意契約(少額)	-	-	-
11	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	ミーティングチェア	0.8	随意契約(少額)	-	-	-
12	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	ノートパソコン VAIO	0.5	随意契約(少額)	-	-	-
13	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	ノートパソコン	0.5	随意契約(少額)	-	-	-
14	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	HP ワークステーション	0.5	随意契約(少額)	-	-	-
15	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	デスクトップパソコン	0.5	随意契約(少額)	-	-	-
16	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	ワークステーション	0.5	随意契約(少額)	-	-	-
17	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	ノートPC	0.5	随意契約(少額)	-	-	-
18	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	ノートパソコン	0.5	随意契約(少額)	-	-	-
19	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	DELL ワークステーション	0.5	随意契約(少額)	-	-	-
20	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	ノートPC	0.5	随意契約(少額)	-	-	-
21	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	ノートパソコン	0.5	随意契約(少額)	-	-	-
22	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	Panasonic ノートパソコン CF-FV3TUUCP	0.5	随意契約(少額)	-	-	-
23	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	ノートパソコン	0.5	随意契約(少額)	-	-	-
24	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	ノートパソコン	0.5	随意契約(少額)	-	-	-
25	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	ノートパソコン	0.5	随意契約(少額)	-	-	-
26	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	Panasonic ノートパソコン CF-SR3TRCCP	0.5	随意契約(少額)	-	-	-
27	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	ノートパソコン	0.5	随意契約(少額)	-	-	-
28	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	冷凍機設計用計算機	0.5	随意契約(少額)	-	-	-
29	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	冷凍機シミュレーション用計算機(デスクトップパソコン)	0.5	随意契約(少額)	-	-	-
30	ヤトロ電子株式会社	8050001016181	DIS Mobile	0.5	随意契約(少額)	-	-	-

	支 出 先	法 人 番 号	業 務 概 要	支 出 額 (百万円)	契約方式等	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	東京電力エナジーパートナー株式会社	8010001166930	干現地区で使用する電気(研究成果の情報発信及び活用促進、中核的期間としての活動)	184	一般競争契約 (最低価格)	1	--	
2	東京電力エナジーパートナー株式会社	8010001166930	並木地区で使用する電気(研究成果の情報発信及び活用促進、中核的期間としての活動)	158	一般競争契約 (最低価格)	1	--	
3	東京電力エナジーパートナー株式会社	8010001166930	桜地区で使用する電気(研究成果の情報発信及び活用促進、中核的期間としての活動)	25	一般競争契約 (最低価格)	2	--	
4	東京電力エナジーパートナー株式会社	8010001166930	並木地区で使用するガス(研究成果の情報発信及び活用促進、中核的期間としての活動)	20	一般競争契約 (最低価格)	1	--	
5	NTT・TCリース株式会社	3010401151289	材料数値シミュレータの賃貸借	23	一般競争契約 (総合評価)	4	--	
6	NTT・TCリース株式会社	3010401151289	材料数値シミュレータの賃貸借	23	一般競争契約 (総合評価)	4	--	
7	NTT・TCリース株式会社	3010401151289	材料数値シミュレータの賃貸借	23	一般競争契約 (総合評価)	4	--	
8	NTT・TCリース株式会社	3010401151289	材料数値シミュレータの賃貸借	23	一般競争契約 (総合評価)	4	--	
9	NTT・TCリース株式会社	3010401151289	材料数値シミュレータの賃貸借	23	一般競争契約 (総合評価)	4	--	
10	NTT・TCリース株式会社	3010401151289	材料数値シミュレータの賃貸借	23	一般競争契約 (総合評価)	4	--	
11	NTT・TCリース株式会社	3010401151289	材料数値シミュレータの賃貸借	23	一般競争契約 (総合評価)	4	--	
12	NTT・TCリース株式会社	3010401151289	材料数値シミュレータの賃貸借	23	一般競争契約 (総合評価)	4	--	
13	NTT・TCリース株式会社	3010401151289	材料数値シミュレータの賃貸借	23	一般競争契約 (総合評価)	4	--	
14	NTT・TCリース株式会社	3010401151289	材料数値シミュレータの賃貸借	23	一般競争契約 (総合評価)	4	--	
15	NTT・TCリース株式会社	3010401151289	材料数値シミュレータの賃貸借	23	一般競争契約 (総合評価)	4	--	
16	NTT・TCリース株式会社	3010401151289	材料数値シミュレータの賃貸借	23	一般競争契約 (総合評価)	4	--	
17	ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社	5020001048718	UVマスク露光装置	77	指名競争契約 (最低価格)	1	--	
18	サムコ株式会社	4130001014511	プラズマCVD装置用SiCトレイ	0.4	随意契約(少額)	-	--	
19	サムコ株式会社	4130001014511	化合物ドライエッチング装置用アルミナシート	0.2	随意契約(少額)	-	--	
20	サムコ株式会社	4130001014511	化合物ドライエッチング装置の冷却水配管交換作業	0.1	随意契約(少額)	-	--	
21	サムコ株式会社	4130001014511	ALD装置用部品	0.1	随意契約(少額)	-	--	
22	サムコ株式会社	4130001014511	原子層堆積装置のコンビネーションバルブメンテナンス	0.1	随意契約(少額)	-	--	
23	サムコ株式会社	4130001014511	プラズマCVD装置用原料(TEOS)	0.1	随意契約(少額)	-	--	
24	サムコ株式会社	4130001014511	化合物ドライエッチング装置の冷却水配管交換作業	0.1	随意契約(少額)	-	--	
25	サムコ株式会社	4130001014511	RIE-101iPH手動マッチング操作説明	0.1	随意契約(少額)	-	--	
26	サムコ株式会社	4130001014511	RIE-101iPH手動マッチング操作説明	0	随意契約(少額)	-	--	
27	サムコ株式会社	4130001014511	化合物ドライエッチング装置の冷却水配管交換作業	0	随意契約(少額)	-	--	
28	サムコ株式会社	4130001014511	原子層堆積装置のコンビネーションバルブメンテナンス	0	随意契約(少額)	-	--	
29	サムコ株式会社	4130001014511	化合物ドライエッチング装置の冷却水配管交換作業	0	随意契約(少額)	-	--	
30	サムコ株式会社	4130001014511	原子層堆積装置のコンビネーションバルブメンテナンス	0	随意契約(少額)	-	--	

[illegible]